

表1. 自主分析不可（技術職員がオペレーション）：技術部協力要請(Web)

装置名	型式	主担当者	副担当	
電子プローブマイクロアナライザ(EPMA)	JXA-8530F	安部	植原	

表2. 利用登録(年度1回)のみで使用可能：技術部設備利用登録申請(Web)

装置名	型式	主担当者	副担当	
接合界面試料準備室	実験研究棟301	水田	植原	
仮金相室	連携研究棟102	遠藤	植原	
3次元微細組織解析装置	NB-5000	植原	遠藤	
顕微レーザーラマン分光装置	ARAMIS LabSpec5	水田	植原	
マイクロX線回折装置	D8 DISCOVER	水田	植原	
試料水平型X線回折装置	UltimaIV/rs	水田	植原	
EBSD付き走査電子顕微鏡	JSM-6400	水田	植原	
イオンスバッタコーター	MSP-1S	遠藤	植原	
真空蒸着装置	JEE-420T	安部	植原	
超深度表面形状測定装置	VK-8550	遠藤	植原	
マイクロピッカース硬度試験装置	HM-221	遠藤	植原	
硬さ自動試験システム	AAV-502	遠藤	植原	
表面粗さ測定機	サーフコム1400D	遠藤	植原	
走査電子顕微鏡	SU-70	遠藤	植原	
ワイヤー放電加工機	HS-300	篠原	植原	
リニアモーター駆動ワイヤー放電加工機	AG360L	篠原	植原	
大電流放電接合装置	Dr.SINTER SPS-1050	篠原	植原	
真空アーク溶解装置	NEV-ADR-04	遠藤	植原	
万能試験機(50t)	RH-50	村井	植原	
高温疲労試験機	EFH-50-5-5	村井	植原	
シャルピー衝撃試験機		村井	植原	
インストロン万能材料試験機	5500R	村井	植原	

表3. 都度、申請書提出が必要：接合研共通設備利用申請(Web)

装置名	型式	主担当者	副担当	
精密タレット型立フライス盤	VHR-SD	花見	植原	
万能帯鋸盤	SE-360	花見	植原	
ボール盤(大)	YBD-450F	花見	植原	
ボール盤(小)	Y80-360	花見	植原	
旋盤(大)	TAL-510	花見	植原	
旋盤(小)	TL-550G	花見	植原	
鋸盤	PSB-350U	花見	植原	
ファインカッター	HS-100	花見	植原	
マイクロカッター		花見	植原	
高速度切断機		花見	植原	
シャーリングマシン	1200mmメカシャーリン	花見	植原	
形削盤	SU-610	花見	植原	
グラインダー		花見	植原	
卓上グラインダー		花見	植原	
溶接機	KR-300	植原	花見	
平面研削盤	PSG-52A	花見	植原	
帯鋸切断機	RB18	花見	植原	
実験棟 ビーム・プラズマ室(10ton)	ホイスト式天井クレーン	植原		
実験棟構造実験室東クレーン(2.8ton)	ホイスト式天井クレーン	水田	村井	植原
実験棟構造実験室西クレーン(2.8ton)	普通型天井クレーン	水田	村井	植原
実験棟溶接・溶断実験室クレーン(2ton)	ホイスト式天井クレーン	水田	村井	植原
RAJA2号館クレーン(2.8ton)	普通型天井クレーン	水田	村井	植原
RAJA2号館クレーン(1ton)	モートルブロック	水田	村井	植原
パワーリフト500kg		花見	村井	
電動フォークリフト 700kg	ニチユ	花見	村井	